

p- and n-doped polymer semiconductor films fabricated by spray deposition

崎山, 晋

<https://hdl.handle.net/2324/2236272>

出版情報 : Kyushu University, 2018, 博士 (工学), 課程博士

バージョン :

権利関係 : Public access to the fulltext file is restricted for unavoidable reason (2)

氏 名	崎山 晋
論 文 名	p- and n-doped polymer semiconductor films fabricated by spray deposition (スプレー堆積法により作製した p 型および n 型ドーパ高分子半導体膜に関する研究)
論文調査委員	主 査 九州大学 教授 服部 励治 副 査 九州大学 准教授 藤田 克彦 副 査 九州大学 教授 柳田 剛

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨

本論文は、高分子半導体への高効率なキャリアドーピング手法を開発するとともに、金属/高分子半導体接合や pn 接合の調製法を確立したうえで、電気特性を解明しており、高効率な高分子半導体デバイス開発を目指す有機エレクトロニクスに寄与するところが大きい。よって、本論文は博士（工学）の学位に値すると認める。